

Doc.No : NR031127-2

2003年11月27日

## 洗浄から乾燥を一槽で処理できる 成膜前工程対応の半導体ウエハー洗浄装置を発売

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区)の半導体機器カンパニー(社長：末武 隆成)は、成膜前洗浄に特化した300ミリウエハー対応のバッチ式\*洗浄装置「F-ONE」を12月から販売します。

半導体デバイスにおける微細化は線幅90ナノメートル(ナノは十億分の一)の量産が始まろうとしています。また、2007年には65ナノメートルまで微細化すると見込まれています。そのような超微細な半導体デバイスにおいては、ウエハー洗浄においても工程ごとに適した洗浄方法が求められ、ウエハー表面のわずかな状態の違いが仕上がり後の特性を大きく左右する成膜前洗浄には、より高精度な処理が必要です。

「F-ONE」は、一槽で複数の薬液処理を可能にした300ミリウエハー対応洗浄装置「FC-3000」の技術を継承、応用し、複数の薬液や純水を使用した洗浄から乾燥までの一連の工程を同一のチャンバー(処理槽)で行えるのが特長。窒素を充填した中で処理を行うため、自然酸化膜の発生を抑制し、ウエハーと回路の間で発生する電気抵抗を改善できるほか、処理が完了するまでウエハーが外気に触れず、大気中の不純物の付着を防ぐことが可能です。また、デバイスにダメージを与えることなく洗浄力を向上させた新技術の搭載により、微細なパーティクル(ゴミ)をはじめ、金属や有機物による汚染などをより確実に除去します。

処理チャンバーを一つにしたことにより装置をコンパクトにし、省スペース化に貢献しているほか、1回の処理で50枚のウエハーを一括処理することで量産用品種に対応した高生産性を実現しています。

\*バッチ式

複数のウエハーを一度に処理できる方式

※この装置は、12月3日から5日まで千葉・幕張メッセで開催される展示会「SEMICON Japan」で紹介します。

### <販売開始予定>

2003年12月

### <国内希望販売価格(消費税別)>

2億円～(仕様により異なる)

### <初年度販売台数>

10台



F-ONE

☆この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、下記URLよりダウンロードできます。  
(<http://www.screen.co.jp/press/nr-photo/>)

●本件についてのお問い合わせ先

大日本スクリーン製造株式会社 本社広報室：Tel 075-414-7131 Fax 075-431-6500 〒602-8585 京都市上京区堀南通寺之内上ル4丁目